

【별표 제1호_상용화 대상 기술 조사표】

상용화 대상 기술 조사표

연구자	김현우 / 한국형발사체개발사업본부 발사체보증팀	
기술명(국문)	기계부품 표면 자동이물검사방법	
기술명(영문)	Automatic Particle Inspection Method	
기술개요	기계부품, 반도체 웨이퍼, 디스플레이용 기판 등의 표면에 오염된 이물을 자동으로 검사하는 기술임	
기술동향	국내	산업 분야에서 널리 사용되고 있는 기술임
	해외	산업 분야에서 널리 사용되고 있는 기술임
시장동향	국내	산업 분야에서 널리 사용되고 있는 기술임
	해외	산업 분야에서 널리 사용되고 있는 기술임
활용방안	산업 분야에서 널리 사용되고 있는 기술임	
관련 연구과제	SR1601F	
실투입 연구개발비	10,000,000 원	
특허정보	해당사항 없음	
기술이전범위 (세부 대상)	소프트웨어 소스 코드, 하드웨어/소프트웨어/검사절차 매뉴얼	